

「次世代プリントドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」(事後評価)

今後の予定

2019年10月28日(月) 10:00-16:45

評価分科会(後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

質問受付・質問回答

2019年10月30日(水)

質問票の提出(評価委員)

提出先: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 谷田 和尋宛

※質問票への回答(推進部署・実施者)は11月1日(金)までに評価部谷田へ提出

評価コメントの作成・取り纏め

2019年11月8日(金)

評価コメント及び評点票の提出(評価委員)

提出先: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 谷田 和尋宛

2019年11月29日(金)頃まで

評価(原案)の取り纏め(分科会長・事務局)後、評価委員に配布

2019年12月4日(木)頃まで

評価(原案)の確認・了承(評価委員)後、推進部署・実施者に配布

評価コメント応答

2019年12月12日(金)頃まで

意見書(事実誤認の確認、補足説明)の作成(推進部署・実施者)

2019年12月17日(火)

意見書を踏まえ、評価(案)の確定(分科会長)

評価報告書の確定

研究評価委員会にて評価報告書(案)を審議、承認の上、確定。